2D11

## Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)超薄膜の表面・界面・基板を選別した局所価電子状態の研究

(愛媛大院・理エ<sup>1</sup>, KEK・物構研<sup>2</sup>)

〇田原 雅士<sup>1</sup>, 山口 勝広<sup>1</sup>, 垣内 拓大<sup>1</sup>, 間瀬 一彦<sup>2</sup>, 長岡 伸一<sup>1</sup>

【序】Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜表面界面の局所価電子状態は、Si 表面科学の基礎研究としてだけ でなく、半導体産業からも注目を集める重要な研究課題である。Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si 超薄膜の初期窒化過程や 表面構造は Si-2p 内殻光電子分光法や走査トンネル顕微鏡等を用いて多くの研究が行われてきた が、物性を支配する表面界面の局所価電子状態を、Si 原子の化学状態(サイト)を選別して議論 した研究例は少ない。そこで我々は、特定化学状態にある原子近傍の局所価電子状態を反映した Si- $L_{23}VV$  オージェ電子スペクトル (AES)を測定できるオージェ電子-光電子コインシデンス分光 法 (Auger photo-electron coincidence spectroscopy : APECS)を用いて、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜の 表面界面を選別した局所価電子状態の研究を行った。

【実験】APECS 測定は、高エネルギー加速器研究機構 Photon Factory の BL-1C, 12A に超高真空槽(~ $1.7 \times 10^8$  Pa)を設置し、 電子-電子-イオンコインシデンス(electron-electron-ion coincidence、EEICO)分光器(図1)を用いて行った[1]。EEICO 分光器は、同軸対称鏡型電子エネルギー分析器(ASMA)、ダ ブルパス円筒鏡型電子エネルギー分析器(DP-CMA)等から構 成され、エネルギー分解能( $E/\Delta E$ )は共に~55 程度であり、コ インシデンス検出効率は、最大~2 cps であった。



図1. APECS 装置の断面図[1]

Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜は、850°Cに加熱した Si(111)-7×7 清浄表面を NH<sub>3</sub> ガスに曝露して作製 し、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-quadruplet 超薄膜は 1050°Cに加熱した Si(111)-1×1 清浄表面を NH<sub>3</sub> ガスに曝露し て作製した。再構成表面が生成していることは低速電子回折(LEED)像と Si-2p 光電子スペクト ル (PES)により確認した。長時間測定後の試料の崩壊、チャージアップ等は無視できる程度で あった。

励起光は、光エネルギー(*hv*)を130 eV に設定し、試料表面法線方向 84°から入射した。 【結果と考察】

①<u>膜厚 1.8Å-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜試料のサイト選別 Si-L<sub>23</sub>VV-Si-2p APECS 測定</u>

図2は、DP-CMA を用いて測定した膜厚 1.8Å-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 試料の Si-2p PES である。我々は、 J. W. Kim らの結果[2]を参照し、Voigt 関数を用い て Si-2p PES のカーブフィッティングを行った。 その結果、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 表面界面近傍には、Si に結合した窒素の数が異なる状態の Si<sup>0</sup>, Si<sup>1+</sup>, Si<sup>3+</sup>, Si<sup>4+</sup>サイトが存在することがわかった。図2中に示 した波線は、APECS 測定のトリガーに用いた Si<sup>n+</sup>-2p 光電子 (n = 0, 1, 3, 4) 成分の相対的運動 エネルギー ( $\Delta KE$ ) 位置を示している。





図3は1.8Å-Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8の表面界面近傍に存在す る、異なる化学状態の Si<sup>n+</sup>から放出された Si<sup>n+</sup>-2p 光電子 シグナル (n = 0, 1, 3, 4) をトリガーシグナルとして測定 した Si-*L*<sub>23</sub>*VV* オージェ電子スペクトル (Si-*L*<sub>23</sub>*VV*-Si<sup>n+</sup>-2*p* APECS、(n = 0, 1, 3, 4), filled square and solid line) と、通 常のオージェ電子スペクトル (Singles Si-L23 VV AES, solid line) である。図3より、Si- $L_{23}VV$ -Si<sup>n+</sup>-2p APECS と Singles Si-L<sub>23</sub>VV AES、各 Si-L<sub>23</sub>VV-Si<sup>n+</sup>-2p APECS も異なるスペク トル構造を示していることがわかる。これは、 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 表面界面近傍に存在する異なる化学状 態の Si<sup>n+</sup>を選別した Si<sup>n+</sup>-L<sub>23</sub>VV AES の測定に成功したこと を示している。通常、低い運動エネルギー(KE)をもつ オージェ電子は、深いエネルギー準位の価電子帯から放 出されることが知られているため、価電子帯は、Si<sup>n+</sup>サイ トの価数が増加するに従ってより深いエネルギー準位側に シフトしていることを示している。



図3. Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)超薄膜試料 のSi-L<sub>23</sub>VV-Si<sup>n</sup>-2p APECS (*n* = 0, 1,3,4) と Singles AES。

②<u>異なる膜厚の Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜試料の表面 Si<sup>4+</sup>サイト Si-L<sub>23</sub>VV-Si<sup>4+</sup>-2p APECS 測定</u>

異なる膜厚の Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8 超薄膜試料の Si-2pPES 測定し、フィッティングを行った結果、曝露時間 が増加するに従って Si<sup>4+</sup>サイトのピーク面積が大きく なり、表面 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>層が厚くなることがわかった。

図 4 は、0.7Å (~0.7 層)、3.6Å (~3.5 層)の  $i_{13}N_4/Si(111)$ -8×8 の各膜厚での Si- $L_{23}VV$ -Si<sup>4+</sup>-2p APECS (□と●)である。Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 膜厚 0.7Å の APECS は 3.6Å のものに比べて高 *KE* 側の強度が強い。これは、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 膜厚 が薄くなるのに従い、表面 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (Si<sup>4+</sup>サイト)の価電子帯上端がフェルミ準位側にシフトしていることを示している。

③<u>Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-8×8, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si(111)-quadruplet の表面サイト選別 Si-L<sub>23</sub>VV-Si<sup>4+</sup>-2p APECS 測定</u>

図 5 は、膜厚 3.1Å- $Si_3N_4/Si(111)$ - $8\times 8$ ,膜厚 3.6Å- $Si_3N_4/Si(111)$ -quadruplet の  $Si-L_{23}VV$ - $Si^{4+}-2p$  APECS (□と●)である。 $Si_3N_4/Si(111)$ -quadruplet の APECS の高 KE 側の強度が強いことは、 $Si_3N_4/Si(111)$ -quadruplet 表面の価電子帯上端が $Si_3N_4/Si(111)$ - $8\times 8$ 表面の価電子帯上端よりもフェルミ準位側にシフトしていることを示しており、界面構造の違いの影響が寄与していると考えられる。

## 【参考文献】

[1]T. Kakiuchi *et al.*, J. Vac. Soc. Jpn. **51**, 749 (2008)
[2]J. W. Kim *et al.*, Phys. Rev. B **67**, 035304 (2003)





